フォトニクスセンター共用装置一覧

設計 機 物細加工 動 で 表 と 学 測定	構造設計ソフト 光学系設計ソフト 機械加工プログラム作成ソフト ナノインプリント装置 フイヤーボンダー 表面段差計 レーザー干渉計 共焦点レーザー顕微鏡 到立顕微鏡	P3-205 P3-205 P3-207 P3-517 P3-517 A1-215 A1-219	× × × O O	¥13,000 ¥10,000		× × × ×
微細加工を表面評価を対し、対象を対象を対象を表面に対象を表し、対象を対象を対象を対象を表現し、対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	機械加工プログラム作成ソフト ナノインプリント装置 フイヤーボンダー 表面段差計 レーザー干渉計 共焦点レーザー顕微鏡	P3-207 P3-517 P3-517 A1-215 A1-219	× O O			×
機細加工 プラス ままれる ままま ままま ままま ままま ままま ままま まままま まままま	ナノインプリント装置 フイヤーボンダー 表面段差計 レーザー干渉計 共焦点レーザー顕微鏡	P3-517 P3-517 A1-215 A1-219	0	¥10,000	_	×
微細加工	フイヤーボンダー 表面段差計 レーザー干渉計 共焦点レーザー顕微鏡	P3-517 A1-215 A1-219	0	¥10,000	_	
表面評価 表面評価 大学測定	表面段差計 レーザー干渉計 共焦点レーザー顕微鏡	A1-215 A1-219		¥10,000	_	
表面評価 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	レーザー干渉計 共焦点レーザー顕微鏡	A1-219	0		_	×
大学測定 エ	共焦点レーザー顕微鏡			¥10,000	_	×
光学測定 エ			×			×
光学測定 エ	到立顕微鏡	P3-309	0	¥30,000		×
光学測定 コ		P3-309	×			×
<u> </u>	マイクロプレートリーダー	P3-309	0			×
 	エリプソメーター	A1-215	0			×
ľ	デジタルマイクロスコープ	A1-215	×			×
_	マルチチャンネル分光器	A1-219	0			×
片	紫外可視近赤外分光光度計	A1-215	0			×
+	サーマルサイクラー	P3-309	×	¥15,000	_	×
	ゼータ電位計	P3-309	0			× (*1)
カヤ オ	ポテンショスタット	P3-309	×			×
J	ナノサイト	A1-219	0			×
3	BDプリンター	P3-205	0	_	¥3,000	0
_	マスクレス露光装置	P3-517	0	_	¥500	× (*2)
集	集束イオンビーム加工・観察装置	A1-215	0	_	¥3,200	×
=	コンパクトスパッタ	A1-215	0	_	¥1,500	×
戊	広視野ラマン顕微鏡	P3-309	0	_	¥1,300	×
機種毎レ	レーザーラマン顕微鏡	P3-309	0	_	¥1,300	×
S	SEM-EDX	A1-215	0	_	¥1,000	×
隶	圭査型プローブ顕微鏡	P3-309	0	_	¥1,000	× (*3)
7	プラズマクリーナー	P3-517	0	_	¥1,000	×
堂	蛍光分光光度計 	P3-309	0	_	¥500	×
显	頁微FT-IR ————————————————————————————————————	P3-309	0	_	¥1,500	×
7	スピンコーター	P3-517	×	_	¥0	×
3	ミクロトーム	A1-215	×	_	¥0	×
7	プラチナコーター	A1-215	×	_	¥0	×
<u> </u>	ドラフト	P3-309	×	_	¥0	×
 	超純水製造装置	P3-309	×	_	¥0	×
申請不要	製氷機	P3-309	×	_	¥0	×
<u> </u>	分析天秤	P3-309	×	_	¥0	×
 	p H測定器	P3-309	×	_	¥0	×
	ナシロスコープ	P3-205	×	_	¥0	×
	実体顕微鏡 寺参のこと (*2):レジストは持参	A1-219	×		¥0 3):カンチレバ	×